

CENTER FOR DEEP LEARNING IN ELECTRONICS MANUFACTURING

电子制造深度学习中心，由 NUFLARE TECHNOLOGY, MYCRONIC AND D2S 主导，利用 NVIDIA 技术，今天宣告成立

新的深度学习中心会推动电子设计和制造的创新和发明

圣荷西, 加州, 美国, 二零一八年九月十二日—三个电子工业界的主导公司联盟今天宣布成立电子制造深度学习中心(CDLe)。认识到对电子制造改进的潜力，这三个业界先驱，包括NuFlare Technology, Mycronic AB 和 D2S, Inc. 建立了这个中心，来推进最尖端的深度学习在它们相关领域的应用。

设置在加州，圣荷西，电子制造深度学习中心(CDLe)提供一个合作的环境，得以集聚人才和资源来加速深度学习在各公司相应专门领域的产品上的应用。借助于NVIDIA GPUs和深度学习知识，中心会帮助相应公司客户快速增加应用各公司基于深度学习技术在电子制造领域的先进产品。

深度学习改变编程方式

The CDLe (电子制造深度学习中心)聚焦在深度学习，隶属于人工智能和机器学习，使用高度复杂神经网络算法改变现有的编程方式。不同于编写固定转化输入到输出的软件，深度学习自动学习如何直接运用真实数据预测实际输出。对于不可预测物理世界中的复杂机械，这个方法被证明比传统定点工程更精确。中心合作的重点是借力深度学习解决问题的巨大潜能为电子制造服务。

“我们工作在庞大数据量的环境里”，NuFlare Technology 光罩光刻部部长山田先生(Hirokazu Yamada)表示，“列如，多电子束光罩刻写机在 10 小时里要处理，计算，传输和刻写 540 兆兆字节(Terabyte)数据。除服务于深度学习的大量制造数据之外，有效精准模拟数据提供了在新应用上的训练机会。在我们对 CDLe 承诺和合作的基础上，NuFlare 期待加快投入市场的时间和应用深度学习解决电子制造中的众多挑战。”

Mycronic R&D 副总裁约翰·傅兰赞(Johan Franzén)说道：“很高兴我们持续执行我们依靠数字化的战略方向来扩展我们的产品，增强数据和图像处理功能，进一步强化我们在工业 4.0 应用中的地位。深度学习即能提供解决现存问题的新方法，还能提供新应用和新业务，以帮助我们的客户提高良率，生产率和成绩。中心成立将提供我们接触工业界专家技术和计算能力的机会，以加速我们在这些方面的进步。”

“GPU 加速计算能力促进了近期深度学习的应用和发展，” D2S, Inc. CEO 藤村先生(Aki Fujimura)表示。“仅在十年前，深度学习还只是科学幻想，今天它使得新型软件应用成为可能。NuFlare 是半导体光罩制造机器方面的先驱，Mycronic 是平面显示(FPD)光罩制造机器方面先驱。合起

来，他们代表电子制造供给链上，非常重要的一环。我们期待和这两个业界先驱在 CDLe 中心共同努力，推进服务电子制造工业的深度学习技术。”

NVIDIA 工业应用业务发展领导陈先生(Jerry Chen)强调，“GPU 计算在半导体设计，模拟和制造取得了很大的成功。但是，随着半导体制程技术的进一步缩小，物理模拟变得越来越难。同时，感应数据成指数增长。这给以象深度学习为代表的数数据趋导处理方法带来新的机遇，来辅助物理模型。我们期待协助 CDLe 和他们的努力，以获取突破性结果。”

如需获得更多有关电子制造深度学习中心的信息，请查寻：www.cdle.ai

关于电子制造深度学习中心：

电子制造深度学习中心(CDLe)是电子制造工业先驱的联盟，专注实现深度学习的潜能。CDLe 中心聚集人才和资源来加速深度学习在各公司相应专门领域产品上的应用。中心旨在每个会员加速深度学习的采用，以改进他们服务于相应客户的特定产品。欲了解更多信息，请查讯：www.cdle.ai

CDLe 联络人：

David Moreno (大卫. 穆锐农)

Open Sky Communications

电话：+1 415-519-3915

邮箱：dmoreno@openskypr.com

###